

웨이퍼 면방위 측정용 홀더 및 이를 포함하는 측정 장치

특허등록번호

10-1318934

특허명

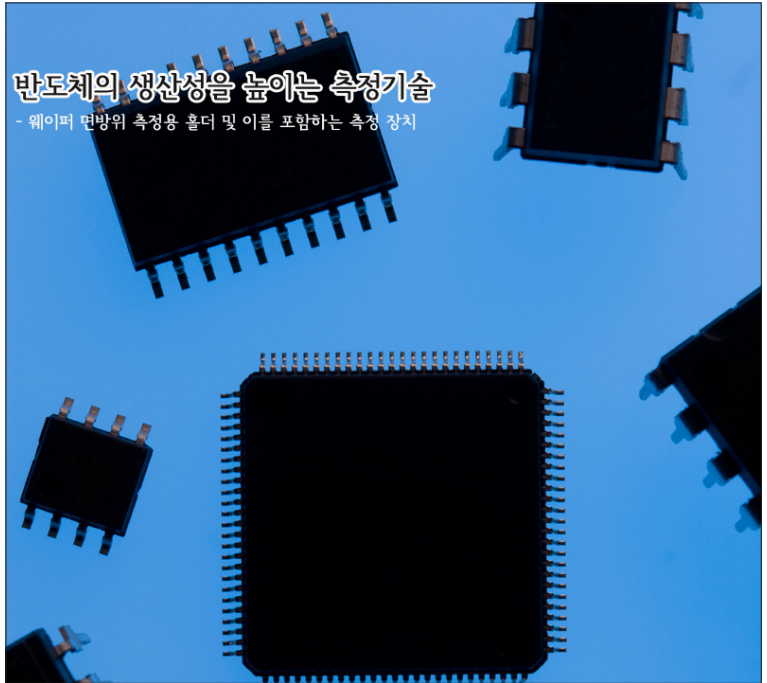
웨이퍼 면방위 측정용 홀더 및 이를 포함하는 측정 장치

대표발명자

신기능재료표준센터 김창수

반도체의 생산성을 높이는 측정기술

- 웨이퍼 면방위 측정용 홀더 및 이를 포함하는 측정 장치



웨이퍼의 상태를 보다 정밀하고 정확하게 측정하는 기술

반도체소자의 재료인 웨이퍼를 보다 정밀하고 정확하게 측정하는 기술을 소개합니다.

해당 기술은 웨이퍼 홀더의 상하 움직임 없이 측정이 가능하며, 웨이퍼의 측정 기준방향을 설정할 수 있을 뿐만 아니라 측정 후 웨이퍼를 회전시켜 추가 측정 또한 가능한 장치 기술입니다.

웨이퍼의 품질을 개선하고 나아가 반도체의 생산성을 향상시켜줄 고마운 기술, KRISS가 함께합니다.

